



دانشگاه سمنان

دانشکده فیزیک

پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک

### موضوع:

تهیه لایه های نازک  $Cd_{1-x}Zn_xS$  با استفاده از نانوذرات  $Cd_{1-x}Zn_xS$  و بررسی  
تأثیر آن روی خواص اپتیکی نمونه های تهیه شده

توسط:

سمیه عزیزی

استاد راهنما:

دکتر حمید رضاقلی پور دیزجی

اسفند ۱۳۹۱



دانشگاه سمنان

دانشکده فیزیک

پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک

تحت عنوان:

تهیه لایه های نازک  $Cd_{1-x}Zn_xS$  با استفاده از نانوذرات  $Cd_{1-x}Zn_xS$  و

بررسی تأثیر آن روی خواص اپتیکی نمونه های تهیه شده

ارائه شده توسط:

سمیه عزیزی

در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۱ توسط کمیته تخصصی زیر مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت:

دکتر حمید رضاقلی پور

دکتر مجید جعفر تفرشی

دکتر نفیسه معماریان

۱- استاد راهنما

۲- استاد داور داخلی

۳- استاد مدعو

سلام الافضل

به یاد

پدر عزیزم

و

تقدیم به

دریای بی کران مهر، مادر م

## پاسکزاری:

... او

او که داشته تا نداشته ایم از اوست... داده بایش مهربانی است و نداده بایش زرف اندیشی...

پیش از همه لازم می دانم از استاد ارجمند جناب آقای دکتر حمید رضا قلی پور که راهبانی و سرپرستی این پروژه بر عهده ایشان بوده است و همچنین یکسری های دلوزانه و راهبانی استادان ایشان پشتوانه علمی و عاطفی برای من به همراه داشته، صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم. انجام و به مر رسیدن این تحقیق مرهون راهبانی، بهمطکری، دلوزی، تلاش مستمر و بی وقفه ایشان بوده است.

از جناب آقای دکتر احسانی که با نظرات ارزنده و لگهای بی دریغ خویش همواره یاری ام کرد، صمیمانه تشکر می کنم و توفیق ایشان را از درگاه خداوند آرزو مندم. همچنین از استادان گرامی و ارجمند جناب آقای دکتر تفرشی و سرکار خانم دکتر معاریان که قبول زحمت کرده و مسئولیت داور این پروژه را به عهده گرفتند، کمال تشکر را دارم.

از سرکار خانم دو ستمدی و خانم حسینی و خانم خرم آبادی به خاطر کمک های بی دریغشان در انجام پروژه پاسکزارم.

همچنین از جناب آقای قوامی که در انجام آزمایش بهمکاری نموده اند پاسکزارم.

# تهیه لایه های نازک $Cd_{1-x}Zn_xS$ با استفاده از نانوذرات $Cd_{1-x}Zn_xS$ و بررسی تأثیر آن روی خواص اپتیکی نمونه‌های تهیه شده

## چکیده

در این پایان نامه ابتدا لایه های نازک، روش های لایه نشانی و کاربردهای آن معرفی می شوند. فصل دوم به معرفی نانوذرات، روشهای ساخت و کاربردهای آن می پردازد. در فصل سوم بررسی ویژگی های اپتیکی لایه های نازک نیمرسانا و روش های اندازه گیری آن ارائه می گردد. در فصل چهارم به منظور بررسی تشکیل نانوذرات  $Cd_{1-x}Zn_xS$ ، آنالیزهای مختلفی از جمله XRD، EDAX و FTIR بر روی نمونه های تهیه شده با  $0 \leq x \leq 1$  انجام گردید. در فصل پنجم به ساخت لایه های نازک  $Cd_{1-x}Zn_xS$  با دمای زیرلایه ۲۰۰ درجه سانتی گراد با استفاده از نانوذرات  $Cd_{1-x}Zn_xS$  اقدام گردید و سپس اثر افزایش Zn روی خواص اپتیکی از جمله ضریب عبور، بازتاب، ضریب خاموشی، ضریب شکست و گاف نواری و خاصیت نورتایی بررسی شد. آنگاه نمونه ها در دمای ۲۵۰، ۳۵۰، ۴۵۰ درجه سانتی گراد بازپخت شده و اثر بازپخت روی خواص اپتیکی بررسی شد. فصل آخر به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات برای مطالعات آتی می پردازد. پیوست ۱ مربوط به تهیه و بررسی لایه های نازک CdTe می باشد که در راستای تحقیقات جاری در آزمایشگاه لایه نشانی دانشکده فیزیک انجام پذیرفت. برای این منظور از روش لایه نشانی خراشان (GLAD) استفاده گردید.

واژه های کلیدی: لایه نازک،  $Cd_{1-x}Zn_xS$ ، نانوذرات، خواص اپتیکی، بازپخت.



**Semnan University**

Faculty Physics

Master of Science

**Subject**

Preparation of  $\text{Cd}_{1-x}\text{Zn}_x\text{S}$  thin films using  $\text{Cd}_{1-x}\text{Zn}_x\text{S}$  nanoparticles and investigation on its effects on optical properties of the prepared samples

**By:**

Somayeh Azizi

**Supervisor:**

Dr. Hamid Rezagholipour Dizaji

March 2013

# **Preparation of Cd<sub>1-x</sub>Zn<sub>x</sub>S thin films using Cd<sub>1-x</sub>Zn<sub>x</sub>S nanoparticles and investigation on its effects on optical properties of the prepared samples**

## **Abstract**

In the present thesis, thin films, the deposition methods and their applications are first introduced. Chapter 2 is devoted to study of the nanoparticles, their production methods and applications. Chapter 3 deals with optical properties of thin films. In chapter 4, the formation of prepared Cd<sub>1-x</sub>Zn<sub>x</sub>S nanoparticles with  $0 \leq x \leq 1$  were studied using XRD, EDAX, FTIR. The construction of Cd<sub>1-x</sub>Zn<sub>x</sub>S thin films using nanoparticles on 200°C heated substrate has been presented in Chapter 5 and then the effect of Zn increasing on optical properties (transmittance, reflectance, extinction coefficient, refractive index, optical band gap) and photoluminescence properties has been studied. Then the samples were annealed at 250, 350 and 450 °C and the annealing effect on the optical properties was investigated. In appendix 1, the CdTe thin films were prepared and investigated as cooperation with the research going on in the Faculty of Physics, Semnan University. For this purpose, glancing angle deposition (GLAD) technique was carried out.

**Keywords:** thin film, Cd<sub>1-x</sub>Zn<sub>x</sub>S, nanoparticles, optical properties, annealing.



# فهرست مطالب

۱	۱. لایه نازک و کاربردهای آن.....
۱-۱	۱-۱ مقدمه.....
۲-۱	۲-۱ تعریف لایه نازک.....
۳-۱	۳-۱ فرآیند رشد لایه نازک.....
۴-۱	۴-۱ اهمیت و کاربرد لایه نازک.....
۵-۱	۵-۱ نقش خلأ در لایه نازک.....
۶-۱	۶-۱ روشهای تهیه لایه نازک.....
۶-۱-۱	۱-۶-۱ روشهای فیزیکی.....
۶-۱-۱-۱	۱-۱-۶-۱ تبخیر حرارتی.....
۶-۱-۱-۲	۲-۱-۶-۱ کندوپاش.....
۶-۱-۱-۳	۳-۱-۶-۱ روشانی خراشان.....
۶-۱-۲	۲-۶-۱ روشهای شیمیایی.....
۲	۲. نانوذرات و کاربرد آنها.....
۱-۲	۱-۲ مقدمه.....
۲-۲	۲-۲ خواص نانو مواد.....
۳-۲	۳-۲ کاربردهای نانوذرات.....

۱۴	.....۱-۳-۲ نشانگرهای بیولوژیکی
۱۵	.....۲-۳-۲ دیودهای نورگسیل
۱۵	.....۳-۳-۲ اتمهای مصنوعی
۱۶	.....۴-۳-۲ عناصر مدارهای نوری
۱۶	.....۵-۳-۲ مولدهای انرژی خورشیدی
۱۶	.....۶-۳-۲ حافظه های کامپیوتری
۱۷	.....۴-۲ روشهای ساخت نانوذرات
۱۷	.....۱-۴-۲ روشهای بالا به پایین و پایین به بالا
۱۷	.....۲-۴-۲ روشهای فیزیکی و شیمیایی
۱۸	.....۳-۴-۲ روشهای حالت مایع، بخار و جامد
۱۸	.....۱-۳-۴-۲ تولید نانوذرات در گازها
۱۸	.....۱-۱-۳-۴-۲ رسوب فیزیکی بخار
۱۹	.....۲-۱-۳-۴-۲ چگالش گاز خنثی
۲۰	.....۳-۱-۳-۴-۲ پاشش حرارتی
۲۰	.....۴-۱-۳-۴-۲ ذوب در محیط فوق سرد
۲۱	.....۵-۱-۳-۴-۲ رسوب شیمیایی بخار (CVD)
۲۲	.....۶-۱-۳-۴-۲ چگالش بخار شیمیایی (CVS)
۲۳	.....۲-۳-۴-۲ تولید نانوذرات در مایعات با روشهای شیمیایی
۲۳	.....۱-۲-۳-۴-۲ روش سل - ژل
۲۴	.....۲-۲-۳-۴-۲ روش رسوب دهی الکتروشیمیایی

۲۴	.....۲-۴-۳-۲ سنتز به روش سونوشیمیایی
۲۵	.....۲-۴-۳-۳ تولید نانوذرات به روش حالت جامد
۲۶	.....۲-۴-۴-۴ تهیه نانوذرات با استفاده از میکروویو
۲۶	.....۲-۴-۴-۱ مقدمه
۲۷	.....۲-۴-۴-۲ مبانی بر همکنش میکروویو با ماده
۲۷	.....۲-۴-۴-۱ فرآیند قطبش دو قطبی
۲۸	.....۲-۴-۴-۲ فرآیند رسانش
۲۹	.....۲-۴-۴-۳ اثر فوق حرارتی
۳۰	.....۲-۴-۴-۴ نقش حلال ها
۳۲	.....۳ ویژگی اپتیکی لایه های نازک
۳۲	.....۳-۱ مقدمه
۳۳	.....۳-۲ خواص اپتیکی بنیادی
۴۰	.....۳-۲-۱ محاسبه ضریب جذب لایه جذب بر روی زیر لایه شفاف
۴۲	.....۳-۲-۲ ثوابت اپتیکی: ضریب جذب، ضریب خاموشی و ضریب شکست
۴۳	.....۳-۳ ویژگی های اپتیکی مواد نیمرسانا
۴۴	.....۳-۳-۱ وابستگی ضریب جذب و گاف نواری
۵۲	.....۳-۳-۲ وابستگی ضریب شکست و گاف نواری
۵۲	.....۳-۳-۳ وابستگی گاف نواری به اندازه دانه
۵۴	.....۳-۴ وابستگی خواص اپتیکی به مرز دانه ها
۵۶	.....۳-۵ روش های مختلف اندازه گیری ثوابت اپتیکی

۵۶	۱-۵-۳ رابطه کرامرز- کرونینگ.....
۵۷	۲-۵-۳ رابطه پراکندگی کوشی.....
۵۸	۳-۵-۳ رابطه پراکندگی سلمیر.....
۵۸	۴-۵-۳ روش فروهی و بلومر.....
۶۰	۵-۵-۳ استفاده از بازتابش و ضریب خاموشی برای محاسبه ضریب شکست لایه جاذب.....
۶۰	۶-۵-۳ روش سان پول.....
۶۵	۱-۶-۵-۳ تخمین ضخامت به وسیله روش سان پول.....
۶۵	۶-۳ فتولومینسانس.....
۶۶	۱-۶-۳ انواع فتولومینسانس.....
۶۶	۱-۱-۶-۳ تابش خود بخودی.....
۶۶	۲-۱-۶-۳ فلورسانس.....
۶۷	۳-۱-۶-۳ فسفرسانس.....
۶۸	۲-۶-۳ گذارهای غیر تابشی.....
۶۹	۳-۶-۳ عوامل موثر در نورتابی نیمرساناها.....
۶۹	۱-۳-۶-۳ فرآیندهای نورتابی.....
۶۹	۱-۱-۳-۶-۳ نورتابی اکسیتونهای مقید شده به ناخالصی ها.....
۷۰	۲-۱-۳-۶-۳ نورتابی زوج دهنده و گیرنده.....
۷۱	۳-۱-۳-۶-۳ ترازهای عمقی.....
۷۳	۴. سنتر نانوذرات $Cd_{1-x}Zn_xS$ به کمک امواج میکروویو.....
۷۳	۱-۴ معرفی $Cd_{1-x}Zn_xS$ .....

۷۴	۲-۴ سولفید روی.....
۷۵	۱-۲-۴ خواص الکترونیکی سولفید روی.....
۷۸	۲-۲-۴ خصوصیات شبکه سولفید روی.....
۷۹	۳-۴ سولفید کادمیم.....
۸۰	۱-۳-۴ خصوصیات الکترونیکی سولفید کادمیم.....
۸۱	۴-۴ ترکیبات سه تایی سولفید روی- کادمیوم و کاربردها.....
۸۲	۵-۴ رشد نانوذرات $Cd_{1-x}Zn_xS$ با استفاده از امواج میکروویو.....
۸۲	۱-۵-۴ مقدمه.....
۸۳	۲-۵-۴ شرح آزمایش.....
۸۴	۶-۴ پراش اشعه ایکس (XRD).....
۸۶	۷-۴ آنالیز EDAX.....
۸۷	۸-۴ طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ (FTIR).....
۹۰	۵. تولید لایه های نازک $Cd_{1-x}Zn_xS$ با استفاده از نانوذرات $Cd_{1-x}Zn_xS$ و بررسی خواص اپتیکی آن.....
۹۰	۱-۵ مقدمه.....
۹۱	۲-۵ دستگاه لایه نشانی.....
۹۱	۱-۲-۵ نحوه عملکرد دستگاه.....
۹۳	۳-۵ آماده سازی دستگاه.....
۹۳	۴-۵ آماده سازی زیر لایه ها.....
۹۴	۵-۵ آماده سازی مواد و انتخاب بوته.....
۹۴	۶-۵ ضخامت سنج.....

۹۶	۷-۵ لایه نشانی لایه های نازک $Cd_{1-x}Zn_xS$ .....
۹۸	۸-۵ بررسی کیفی فیلمهای تهیه شده $Cd_{1-x}Zn_xS$ .....
۹۹	۱-۸-۵ تصاویر FESEM.....
۹۹	۱-۱-۸-۵ عکس از بالا.....
۱۰۱	۲-۱-۸-۵ عکس از کنار.....
۱۰۳	۲-۸-۵ طیف نورتابی (PL).....
۱۰۴	۳-۸-۵ میزان عبور اپتیکی.....
۱۰۵	۴-۸-۵ ضریب جذب، ضریب خاموشی و ضخامت بحرانی.....
۱۰۷	۵-۸-۵ ضریب شکست.....
۱۰۹	۶-۸-۵ گاف نواری.....
۱۱۱	۹-۵ اثر دمای بازپخت بر خواص اپتیکی.....
۱۱۲	۱-۹-۵ عبور اپتیکی.....
۱۱۵	۲-۹-۵ ضریب جذب.....
۱۱۷	۳-۹-۵ ضریب خاموشی.....
۱۲۰	۴-۹-۵ ضریب شکست.....
۱۲۳	۵-۹-۵ گاف نواری.....
۱۲۷	۶. نتیجه گیری و پیشنهادها.....
۱۲۷	۱-۶ نتیجه گیری.....
۱۲۸	۲-۶ پیشنهادات برای فعالیتهای آتی.....
۱۲۹	پیوست ۱ رشد زاویه دار لایه های تلورید کادمیوم بررسی خواص اپتیکی آنها.....

پ ۱-۱ مقدمه.....	۱۲۹
پ ۲-۱ مشخصات دستگاه کنترل شار بخار.....	۱۲۹
پ ۳-۱ عملیات لایه نشانی.....	۱۳۱
پ ۴-۱ بررسی خواص ساختاری و اپتیکی لایه های CdTe.....	۱۳۳
پ ۱-۴-۱ تصاویر FESEM.....	۱۳۳
پ ۱-۴-۱-۱ عکس از بالا.....	۱۳۳
پ ۲-۴-۱-۱ عکس از کنار.....	۱۳۴
پ ۲-۴-۱ عبور اپتیکی.....	۱۳۶
پ ۳-۴-۱ میزان بازتابش.....	۱۳۷
پ ۴-۴-۱ ضریب جذب.....	۱۳۸
پ ۵-۴-۱ ضریب شکست.....	۱۳۹
پ ۶-۴-۱ گاف نواری.....	۱۴۰
پ ۷-۴-۱ اندازه دانه.....	۱۴۱
پ ۱-۷-۴-۱ محاسبه اندازه دانه با استفاده از روش HBM.....	۱۴۱
پ ۲-۷-۴-۱ محاسبه اندازه دانه با استفاده از روش EMA.....	۱۴۱
پیوست ۲.....	۱۴۳
مراجع.....	۱۴۶

## فهرست شکل ها

- شکل ۱-۱: سه نوع سازوکار رشد لایه نازک..... ۴
- شکل ۲-۱: بوته تبخیر و فاصله آن تا زیر لایه..... ۷
- شکل ۳-۱: طرحواره ای از رشد خراشان..... ۱۰
- شکل ۴-۱: اثر سایه اندازی و تشکیل ستون های زاویه دار بر اثر رونشانی خراشان..... ۱۰
- شکل ۱-۲: شماتیکی از روش شیمیایی بخار..... ۲۱
- شکل ۲-۲: طیف الکترومغناطیس و محدوده میکروویو..... ۲۶
- شکل ۳-۲: مکانیزم گرمایش توسط امواج میکروویو (a) قطبش دوقطبی ها (b) رسانش..... ۲۹
- شکل ۴-۲: نمودارهای ثابت دی الکتریک بر حسب دما برای حلال های مختلف..... ۳۰
- شکل ۵-۲: اثر افزودنی مایع یونی بر روی افزایش دمای دی اکسان تحت تابش میکروویو با توان  $300W$ ..... ۳۰
- (منحنی پایین دی اکسان و منحنی بالایی دی اکسان به همراه مایع یون..... ۳۱
- شکل ۱-۳: نمایش S و R، T..... ۳۴
- شکل ۲-۳: تصویر شماتیک یک اسپکتروفوتومتر دوپرتویی. (LS منبع نور، MC مونوکروماتور، CH پروانه چرخان، SC محل قرار دادن نمونه، D آشکارساز، A آمپلی فایر..... ۳۵
- شکل ۳-۳: بخش پایین نمودار بازتابندگی بر حسب  $n_1 d$  برای لایه های نازکی با مقادیر مختلف  $n_1$  بر روی زیرلایه شیشه های با  $n_2 = 1/5$  بخش بالایی نمودار بازتابندگی برای لایه یکنواخت بین دو محیط با ضریب شکست مشابه..... ۳۸
- شکل ۳-۴: عبور و بازتابش متوالی نور عمودی با شدت  $I_0$  در یک لایه. فلش های نقطه چین شده و خط چین شده به ترتیب نماینده نور بازتابی و نور عبوری می باشند..... ۴۱
- شکل ۳-۵: بازه های انرژی امواج الکترومغناطیس و روش های اندازه گیری اپتیکی مربوطه شان..... ۴۳
- شکل ۳-۶: فرایند های اتمی، مولکولی و الکتریکی را در بازه های مختلف انرژی..... ۴۴
- شکل ۳-۷: ضریب جذب به عنوان تابعی از انرژی فوتون تاییده برای نیم رساناهای معمولی..... ۴۵
- شکل ۳-۸: نمای شماتیک از گذار مستقیم (چپ) و غیر مستقیم (راست) در نیم رساناها..... ۴۶
- شکل ۳-۹: چگونگی انتقال الکترون به نوار رسانش بر اثر جذب فوتون..... ۴۷
- شکل ۳-۱۰: نمودار  $(\alpha h\nu)^2$  بر حسب  $h\nu$  نزدیک به لبه جذب برای بلور GaAs..... ۴۸
- شکل ۳-۱۱: نمودار  $(\alpha h\nu)^{1/2}$  بر حسب  $h\nu$  نزدیک به لبه جذب برای بلور Si..... ۴۹



- شکل ۳- ۱۲: جذب نوار به نوار برای Si در دمای 300 K. انرژی های  $E_1$  و  $E_2$  به نقاطی مربوطند که در آنها نمودار E بر حسب k نوار رسانش و ظرفیت با هم موازی اند..... ۵۰
- شکل ۳- ۱۳: نمای کیفی تغییر شکل نوار رسانش و ظرفیت بر اثر تنش مکانیکی ناشی از مرزدانه ها. i: گذار غیر مستقیم، d: گذار مستقیم..... ۵۵
- شکل ۳- ۱۴: خطوط پیوسته توسط روابط فروهی- بلومر رسم شده اند و نقاط مربوط به داده های تجربی برای  $SiO_2$  هستند..... ۵۹
- شکل ۳- ۱۵: برخورد نور با لایه، عبور، شکست، بازتاب و تداخل ها..... ۶۱
- شکل ۳- ۱۶: نمودار عبور از لایه نازک Se با ضخامت ۹۶۹ نانومتر بر روی زیر لایه شیشه..... ۶۱
- شکل ۳- ۱۷: نمودار عبور شیشه سازی شده برای لایه  $1000$  نانومتری  $\alpha-Si:H$  بر روی شیشه بی نهایت..... ۶۲
- شکل ۳- ۱۸: فرآیند جذب و تابش خودبخودی یک فوتون..... ۶۶
- شکل ۳- ۱۹: دیاگرام جاپلونسکی که فرآیندهای گذار الکترونی را در یک مادهی نوعی نشان میدهد. فقط در فرآیند فلورسانس (F) و فسفرسانس (P) تابش نور همراه است..... ۶۸
- شکل ۳- ۲۰: طیف نورتابی نزدیک شکاف انرژی CdS (1.2K)..... ۷۰
- شکل ۳- ۲۱: ترازهای انرژی یک زوج دهنده- پذیرنده..... ۷۱
- شکل ۳- ۲۲: مدل مختصات پیکربندی تراز نقص عمقی. (C نشان دهنده نوار هدایت، V نوار ظرفیت و D نقص عمقی است)..... ۷۲
- شکل ۴- ۱: طرحواره‌های از ساختار سولفید روی مکعبی..... ۷۴
- شکل ۴- ۲: طرح واره‌های از ساختار سولفید روی مدل هگزاگونال..... ۷۵
- شکل ۴- ۳: منطقه اول بریلوئن برای سولفید روی مکعبی..... ۷۵
- شکل ۴- ۴: نوارهای انرژی مدل مکعبی..... ۷۶
- شکل ۴- ۵: وابستگی گاف نواری مدل مکعبی..... ۷۶
- شکل ۴- ۶: منطقه اول بریلوئن برای سولفید روی هگزاگونال..... ۷۷
- شکل ۴- ۷: نوارهای انرژی مدل هگزاگونال..... ۷۷
- شکل ۴- ۸: نمودار تغییرات پارامترهای شبکه بر حسب دما..... ۷۷۸
- شکل ۴- ۹: آرایش اتمی مواد معدنی سولفید کادمیم، (الف) گرینکیت و (ب) هاولیت..... ۸۰
- شکل ۴- ۱۰: منطقه اول بریلوئن برای سولفید کادمیم هگزاگونال..... ۸۰
- شکل ۴- ۱۱: ترازهای انرژی سولفید کادمیم مدل هگزاگونال..... ۸۱

- شکل ۴- ۱۲: نمایی از دستگاه میکروویو..... ۸۳
- شکل ۴- ۱۳: طیف XRD مربوط به نانوذرات  $Cd_{1-x}Zn_xS$  به ازای (۱/۰ و ۰/۰۵ و ۰/۱)..... ۸۴
- شکل ۴- ۱۴: ثابت های شبکه نانوذرات  $Cd_{1-x}Zn_xS$  بر حسب X..... ۸۶
- شکل ۴- ۱۵: طیف EDAX برای نانوذرات  $Cd_{1-x}Zn_xS$  به ازای (۰/۶ و ۰/۲)..... ۸۷
- شکل ۴- ۱۶: نمودار طیف FTIR نانوذرات  $Cd_{1-x}Zn_xS$  به ازای (۰/۸ و ۰/۶ و ۰/۴ و ۰/۲)..... ۸۸
- شکل ۵- ۱: (الف) نمایی از دستگاه لایه نشانی مورد استفاده، (ب) محفظه خلأ..... ۹۱
- شکل ۵- ۲: الکترودهای متقل کننده جریان به بوته..... ۹۲
- شکل ۵- ۳: بوته در پوش دار از جنس مولیبدن..... ۹۴
- شکل ۵- ۴: قسمت الکترونیکی ضخامت سنج..... ۹۵
- شکل ۵- ۵: بلور کوارتز درون محفظه خلأ..... ۹۵
- شکل ۵- ۶: گرمکن تشعشعی..... ۹۶
- شکل ۵- ۷: نمایی از گرمکن..... ۹۷
- شکل ۵- ۸: نمایی از داخل محفظه خلأ دستگاه لایه نشانی در حالت های مختلف..... ۹۸
- شکل ۵- ۹: تصویر FESEM از بالا نمونه  $S_0$ ..... ۹۹
- شکل ۵- ۱۰: تصویر FESEM از بالا نمونه  $S_2$ ..... ۹۹
- شکل ۵- ۱۱: تصویر FESEM از بالا نمونه  $S_3$ ..... ۱۰۰
- شکل ۵- ۱۲: تصویر FESEM از بالا نمونه  $S_5$ ..... ۱۰۰
- شکل ۵- ۱۳: تصویر FESEM از بالا نمونه  $S_6$ ..... ۱۰۰
- شکل ۵- ۱۴: تصویر FESEM از بالا نمونه  $S_7$ ..... ۱۰۱
- شکل ۵- ۱۵: تصویر نمونه  $S_0$  از کنار..... ۱۰۱
- شکل ۵- ۱۶: تصویر نمونه  $S_3$  از کنار..... ۱۰۲
- شکل ۵- ۱۷: تصویر نمونه  $S_6$  از کنار..... ۱۰۲
- شکل ۵- ۱۸: تصویر نمونه  $S_7$  از کنار..... ۱۰۲
- شکل ۵- ۱۹: طیف PL مربوط به نمونه های  $S_0, S_3, S_6, S_7$ ..... ۱۰۴

- شکل ۵-۲۰: مقایسه میزان عبور اپتیکی نمونه های  $S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6$  و  $S_7$ ..... ۱۰۴
- شکل ۵-۲۱: نمودار ضریب جذب نمونه های  $S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6$  و  $S_7$ ..... ۱۰۵
- شکل ۵-۲۲: مقایسه ضریب خاموشی نمونه های  $S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6$  و  $S_7$ ..... ۱۰۶
- شکل ۵-۲۳: نمودار ضخامت بحرانی نمونه های  $S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6$  و  $S_7$ ..... ۱۰۷
- شکل ۵-۲۴: نمودار ضریب شکست بر حسب طول موج برای نمونه های  $S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6$  و  $S_7$ ..... ۱۰۸
- شکل ۵-۲۵: نمودار  $(\alpha hv)^2$  بر حسب  $hv$  برای نمونه های  $S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6$  و  $S_7$ ..... ۱۰۹
- شکل ۵-۲۶: نمودار به دست آمده برای شکاف انرژی  $Cd_{1-x}Zn_xS$  بر حسب  $x$  برای  $0 \leq x \leq 0.4$ ..... ۱۱۰
- شکل ۵-۲۷: نمودار به دست آمده برای شکاف انرژی  $Cd_{1-x}Zn_xS$  بر حسب  $x$  برای  $x > 0.4$ ..... ۱۱۱
- شکل ۵-۲۸: تصویری از دستگاه بازپخت تحت خلأ؛ شامل پمپ خلأ و آبردکن و کوره الکتریکی..... ۱۱۲
- شکل ۵-۲۹: مقایسه میزان عبور اپتیکی نمونه های  $A, A_0, A_1, A_2$ ..... ۱۱۳
- شکل ۵-۳۰: مقایسه میزان عبور اپتیکی نمونه های  $B, B_0, B_1, B_2$ ..... ۱۱۳
- شکل ۵-۳۱: مقایسه میزان عبور اپتیکی نمونه های  $C, C_0, C_1, C_2$ ..... ۱۱۴
- شکل ۵-۳۲: مقایسه میزان عبور اپتیکی نمونه های  $D, D_0, D_1, D_2$ ..... ۱۱۴
- شکل ۵-۳۳: نمودار ضریب جذب نمونه های  $A, A_0, A_1, A_2$ ..... ۱۱۵
- شکل ۵-۳۴: نمودار ضریب جذب نمونه های  $B, B_0, B_1, B_2$ ..... ۱۱۶
- شکل ۵-۳۵: نمودار ضریب جذب نمونه های  $C, C_0, C_1, C_2$ ..... ۱۱۶
- شکل ۵-۳۶: نمودار ضریب جذب نمونه های  $D, D_0, D_1, D_2$ ..... ۱۱۷
- شکل ۵-۳۷: مقایسه ضریب خاموشی نمونه های  $A, A_0, A_1, A_2$ ..... ۱۱۸
- شکل ۵-۳۸: مقایسه ضریب خاموشی نمونه های  $B, B_0, B_1, B_2$ ..... ۱۱۸
- شکل ۵-۳۹: مقایسه ضریب خاموشی نمونه های  $C, C_0, C_1, C_2$ ..... ۱۱۹
- شکل ۵-۴۰: مقایسه ضریب خاموشی نمونه های  $D, D_0, D_1, D_2$ ..... ۱۱۹
- شکل ۵-۴۱: نمودار ضریب شکست بر حسب طول موج برای نمونه های  $A, A_0, A_1, A_2$ ..... ۱۲۰

- شکل ۵-۴۲: نمودار ضریب شکست بر حسب طول موج برای نمونه های  $B_0, B_1, B_2$  ..... ۱۲۱
- شکل ۵-۴۳: نمودار ضریب شکست بر حسب طول موج برای نمونه های  $C_0, C_1, C_2$  ..... ۱۲۱
- شکل ۵-۴۴: نمودار ضریب شکست بر حسب طول موج برای نمونه های  $D_0, D_1, D_2$  ..... ۱۲۲
- شکل ۵-۴۵: نمودار  $(\alpha hv)^2$  بر حسب  $hv$  برای نمونه های  $A_0, A_1, A_2$  ..... ۱۲۳
- شکل ۵-۴۶: نمودار  $(\alpha hv)^2$  بر حسب  $hv$  برای نمونه های  $B_0, B_1, B_2$  ..... ۱۲۴
- شکل ۵-۴۷: نمودار  $(\alpha hv)^2$  بر حسب  $hv$  برای نمونه های  $C_0, C_1, C_2$  ..... ۱۲۴
- شکل ۵-۴۸: نمودار  $(\alpha hv)^2$  بر حسب  $hv$  برای نمونه های  $D_0, D_1, D_2$  ..... ۱۲۵
- شکل پ ۱-۱: نمای شاتر چرخان در دستگاه لایه نشانی، A- موتور DC گیربکس دار، B- شاتر ثابت، C- شاتر چرخان، D- زیرلایه، E- میلگرد نگهدارنده سیستم موتور و شاتر چرخان و ثابت، F- چشمه قایقی شکل،  $G_1, G_2$  الکترودها ..... ۱۳۰
- شکل پ ۱-۲: سیستم کنترل شار بخار همراه با فضای استوانه ای بسته نصب شده به شاتر چرخان ..... ۱۳۰
- شکل پ ۱-۳: تصویر شاتر و استوانه مربوطه در داخل محفظه خلأ ..... ۱۳۱
- شکل پ ۱-۴: طرحواره های از قرار گرفتن نمونه ها در سیستم ابداعی ..... ۱۳۱
- شکل پ ۱-۵: منبع تغذیه و اتصالات آن به درون محفظه ..... ۱۳۲
- شکل پ ۱-۶: تصویر FESEM از بالا نمونه های a, b و c ..... ۱۳۴
- شکل پ ۱-۷: تصویر FESEM از کنار نمونه های a, b و c ..... ۱۳۵
- شکل پ ۱-۸: مقایسه میزان عبور اپتیکی نمونه های a, b و c ..... ۱۳۷
- شکل پ ۱-۹: میزان بازتابش از نمونه های a, b و c ..... ۱۳۸
- شکل پ ۱-۱۰: مقایسه ضریب جذب نمونه های a, b و c ..... ۱۳۹
- شکل پ ۱-۱۱: مقایسه ضریب شکست نمونه های a, b و c ..... ۱۴۰
- شکل پ ۱-۱۲: نمودار  $(\alpha hv)^2$  بر حسب  $hv$  برای نمونه های a, b و c ..... ۱۴۱